

# 新型工業用プラズマ測定装置

- ・絶縁状態でプラズマ測定が可能な測定装置を世界で初めて開発
- ・スパッタやドライエッチング装置等各種プラズマの性能評価に威力を発揮します

## 【装置性能】

- (1) プラズマ電位、電子温度、電子密度等の諸量を0.5秒の短時間で測定
- (2) 石英管内や絶縁壁容器内のプラズマでもプラズマ量の測定が可能
- (3) プラズマソースの特性に応じて測定プログラムのデザイン変更が可能

## 【応用技術分野】

- (1) 半導体製造装置のプラズマ測定・制御
- (2) デポフリーな膜堆積プラズマの測定
- (3) 反応性スパッタの遷移領域測定・制御
- (4) SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>等の実ガスプラズマ測定・分析

## 【チャンバーへの実装】

- (1) 6Φ Cajon Adaptor他各種オプション
- (2) プローブ材料W、Ti等各種オプション
- (3) デポフリープローブの提供可

連絡先:

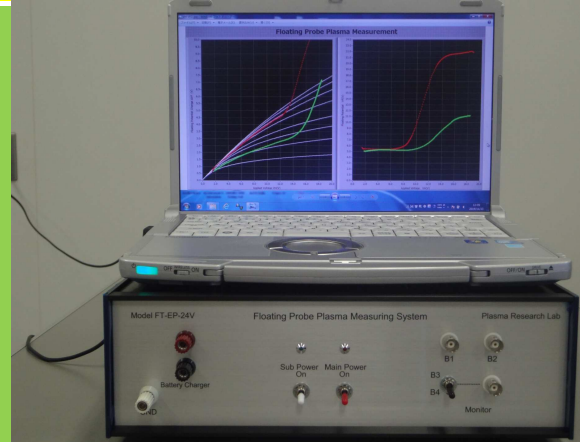
(株)プラズマ理工学研究所

〒243-0035 厚木市下愛甲2丁目11番5-309  
TEL: 046-250-7557 FAX: 046-250-7557  
Email: shindo-h@zpost.plala.or.jp

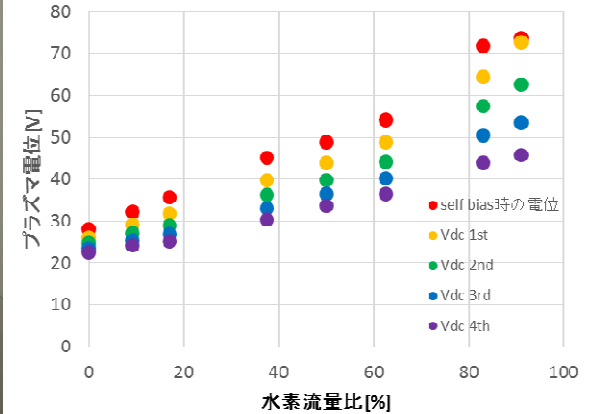
神奈川県産業技術センター

〒243-0435 海老名市下今泉705-1  
TEL: 046-236-1500(代表)

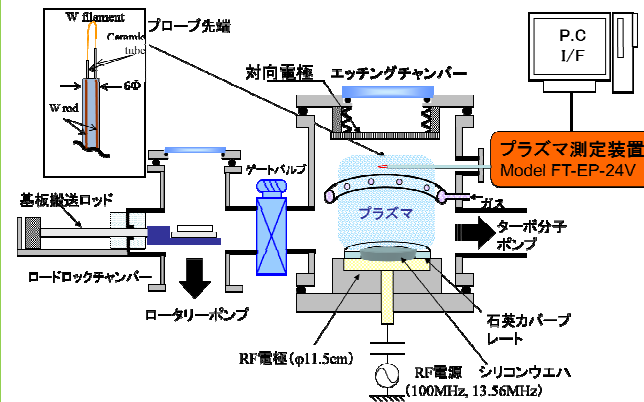
支援担当者: 電子技術部 電子デバイスチーム 湯浅宏康



測定装置本体とPCモニター

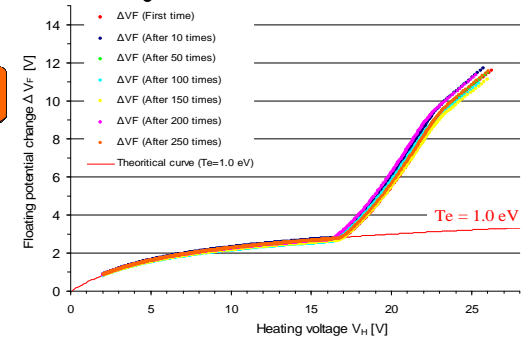


反応性スパッタでのプラズマ電位測定例



プラズマ測定の実施例

## SF<sub>6</sub>エッチングプラズマ



半導体製造実ガスでの測定例